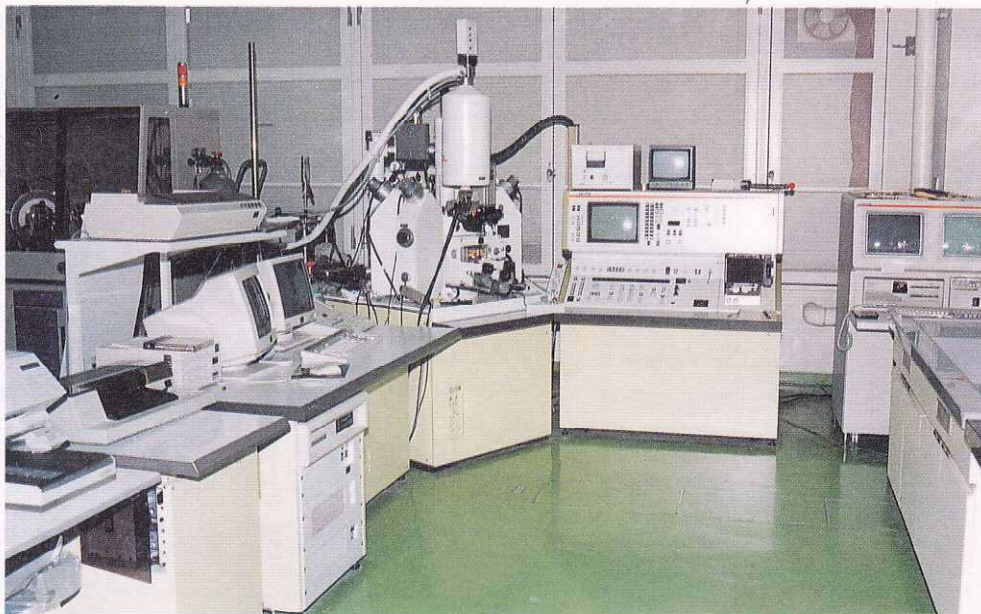


6. 研究設備

6. 1 主要な設備



電子線プローブマイクロアナライザー



PVD装置



薄膜・微小領域 X 線回折装置



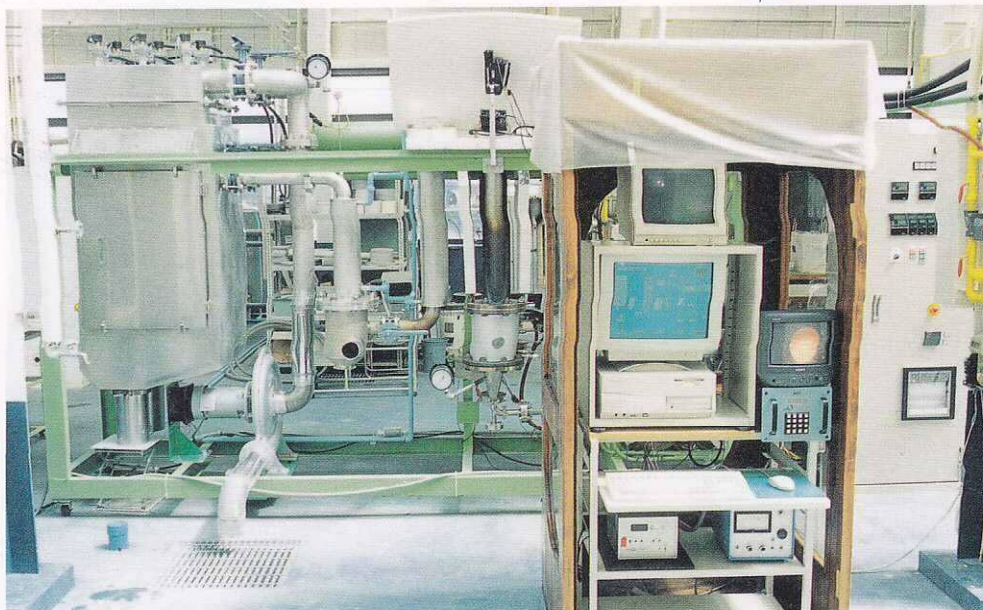
全自動蛍光 X 線分析装置



ガスクロマトグラフ質量分析計



高速液体クロマトグラフ質量分析装置



バルーン製造装置



実大試験機



マシニングセンター



NCルーター